

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成27年3月19日(2015.3.19)

【公開番号】特開2013-167812(P2013-167812A)

【公開日】平成25年8月29日(2013.8.29)

【年通号数】公開・登録公報2013-046

【出願番号】特願2012-31850(P2012-31850)

【国際特許分類】

G 03 B 21/14 (2006.01)

G 03 B 21/00 (2006.01)

H 04 N 5/74 (2006.01)

【F I】

G 03 B 21/14 Z

G 03 B 21/00 E

H 04 N 5/74 B

【手続補正書】

【提出日】平成27年1月30日(2015.1.30)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0081

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0081】

第1の光W1GRは第2の光分離光学系62によって、第3の光Gと第4の光Rとに分離され、第2の光W2YBは第2の光分離光学系62によって、第5の光Bと第6の光Yとに分離される。さらに、第2の光分離光学系62は、第3の光Gと第4の光Rと第5の光Bと第6の光Yとを、YZ平面と交差する方向に射出する。第1実施形態と同様に、位置A3と位置A4と位置A5と位置A6は、画素PX内において擬似マトリクス状に位置している。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0090

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0090】

第1の光W1GYは第2の光分離光学系72によって、第3の光Gと第4の光Yとに分離され、第2の光W2RBは第2の光分離光学系72によって、第5の光Rと第6の光Bとに分離される。さらに、第2の光分離光学系72は、第3の光Gと第4の光Yと第5の光Rと第6の光Bとを、YZ平面と交差する方向に射出する。本実施形態においても、位置A3と位置A4と位置A5と位置A6は、画素PX内において擬似マトリクス状に位置している。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0114

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0114】

第2基板93は、マイクロレンズアレイ81と、第1透明基板92と、第2透明基板9

8と、を備えている。マイクロレンズアレイ81の光射出側には厚みが40μm～50μmの薄い第1透明基板92が接合されている。また、マイクロレンズアレイ81の光入射側には厚みが1.0mm～1.4mmの厚い第2透明基板98が接合されている。マイクロレンズアレイ81および第1透明基板92が厚い第2透明基板98と接合されることで、マイクロレンズアレイ81および第1透明基板92の強度が補強されている。